

## 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司东莞安晟半导体技术有限公司于近日取得一项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

证书号：第 5952661 号

发明名称：一种磷化铟晶圆的切割方法及控制系统

专利号：ZL 2021 1 0645549.6

专利类型：发明专利

专利申请日：2021 年 06 月 10 日

专利权人：东莞安晟半导体技术有限公司、东莞铭普光磁股份有限公司

授权公告日：2023 年 05 月 09 日

专利权期限：20 年（自申请日起算）

本发明涉及晶圆处理技术领域,具体涉及一种磷化铟晶圆的切割方法及控制系统,切割方法包括:首先将晶圆放置在箍环绷紧的蓝膜上,然后根据晶圆的切割道宽度选取对应的切割刀片,根据晶圆的切割道宽度、晶圆的厚度以及芯片大小设定对应的切割参数,切割刀片按照切割参数对装配好的晶圆进行自动机械切割,最后对切割好的晶圆进行去离子水清洗后风淋甩干。切割控制系统包括:晶圆装配器、晶圆切割控制器和晶圆清洗处理器。本发明通过装配晶圆、切割晶圆和清洗、风淋甩干晶圆实现了对磷化铟晶圆的一次性自动机械切割,有效提高了切割效率;通过切割控制系统实现了整个晶圆切割工艺的自动化加工,提高了晶圆切割的加工精度和芯片的成品率。

上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响,但有利于充分发挥公司自主知识产权优势,完善知识产权保护体系,对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响,形成持续创新机制,提升公司核心竞争力。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2023年5月23日